

淡江大學 101 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	半導體製程設備	授課 教師	韓謝忱 HAN, HSIEH-CHENG
	THE PROCESSING MACHINES OF MICROCHIP FABRICATION		
開課系級	機電四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TEBXB4P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、教育學生應用數學、科學及工程的原則，使其有能力從事機電工程相關的實務或學術研究。</p> <p>二、培養健全的專業工程師，使其專業素養與工程倫理認知能充分發揮於職場，符合社會需求。</p> <p>三、培育學生具備全球競爭的基本技能，以面對不同的生涯發展，並能持續終身學習。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 學理基礎。</p> <p>B. 工程科學能力。</p> <p>C. 資訊化能力。</p> <p>D. 獨立解決問題能力。</p> <p>E. 實務操作與數據分析能力。</p> <p>F. 表達能力。</p> <p>G. 團隊溝通能力。</p> <p>H. 終身學習。</p> <p>I. 外語能力。</p>			
課程簡介	本課程提供學生對半導體製程設備之全面瞭解，其牽涉到電子、材料、物理、化學、與機械等跨領域知識的合作與學習。		
	This course provides the overall understanding of the THE PROCESSING MACHINES OF MICROCHIP FABRICATION involving the system integration of electronics, material science, physics, chemistry, and mechanics.		

本課程教學目標與目標層級、系(所)核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系(所)核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應其「系(所)核心能力」。單項教學目標若對應「系(所)核心能力」有多項時，則可填列多項「系(所)核心能力」。(例如：「系(所)核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列。)

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系(所)核心能力
1	(1.2)培養學生具備工程應用之能力。	1	C3	ABCDEFGHI
2	(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。	2	C3	ABCDEFGHI
3	(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。	3	C3	ABCDEFGHI

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	(1.2)培養學生具備工程應用之能力。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論
2	(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論
3	(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◇ 全球視野	
◇ 洞悉未來	
◇ 資訊運用	
◇ 品德倫理	
◇ 獨立思考	
◇ 樂活健康	
◇ 團隊合作	
◇ 美學涵養	

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/02/18~ 102/02/24	Introduction to the Semiconductor Industry	
2	102/02/25~ 102/03/03	Characteristics of Semiconductor Materials	
3	102/03/04~ 102/03/10	Silicon and Wafer Preparation	
4	102/03/11~ 102/03/17	Chemicals in Semiconductor Fabrication	
5	102/03/18~ 102/03/24	Contamination Control in Wafer Fabs	
6	102/03/25~ 102/03/31	Metrology and Defect Inspection	
7	102/04/01~ 102/04/07	Gas Control in Process Chambers	
8	102/04/08~ 102/04/14	IC Fabrication Process Overview	
9	102/04/15~ 102/04/21	Thin film deposition	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	Photolithography	
12	102/05/06~ 102/05/12	Etching	

13	102/05/13~ 102/05/19	Testing, Assembly and Packaging	
14	102/05/20~ 102/05/26	Current & Future Trends	
15	102/05/27~ 102/06/02	畢業考試週	
16	102/06/03~ 102/06/09	---	
17	102/06/10~ 102/06/16	---	
18	102/06/17~ 102/06/23	---	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		Michael Quirk & Julian Serda, Semiconductor Manufacturing Technology, © October 2001 by Prentice Hall (滄海書局)	
參考書籍		請參酌本人提供在淡江大學網頁"教學支援平台"之資料	
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆出席率： % ◆平時評量：40.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。	